

Agilent オクタポールリアクションシステムと ヘリウムコリジョンモードを使用した ICP-MS でのスペクトル干渉の一斉除去 アプリケーション

金属分析

著者

Ed McCurdy, Glenn Woods and Don Potter Agilent Technologies Lakeside Business Park Cheadle Royal, Cheshire UK

要旨

多くのルーチンの分析機関は、ICP-MS が多元素同時分析 装置として操作が簡単なため、金属分析のための主要技 術として採用してきた。しかしながら、マトリクスによ る固有の干渉の除去性能が高いにもかかわらず、コリジ ョン/リアクションセル(CRC) ICP-MS は、どちらかと いえば、他の多元素同時分析装置の代役として考えられ ている。このレポートは、Agilent 7500ce ICP-MS を用い、 困難とされてきた複雑なサンプルマトリクスでの測定対 象元素への干渉を He コリジョンガスの1条件だけで効 果的に除去できることを述べる。

はじめに

ICP-MS は非常に強力な多元素同時分析技術であるが、 いくつかの特有のスペクトル干渉の影響を受け、複雑で 幅広い種類のサンプルを分析する場合には、特に解決が 難しくなることがある。ICP-MS の干渉の大部分は、測 定対象元素と同じ質量数の分子(または多原子)イオン の重なりにより生じる。一般的に報告される干渉は、大 まかに次の 2 グループに分けられる: 40 Ar 40 Ar 16 O、お よび 40 Ar 38 Ar などのプラズマおよび水溶液に起因する干 渉と、 35 Cl 16 O、および 32 S 34 S などのサンプルマトリック ス成分に起因する干渉である。プラズマに起因する多原 子イオンは、サンプルマトリックスに関係なく予測可能 であり、ある程度一定であるが、サンプルマトリックス に起因する多原子イオンは、サンプルマトリックス成分 およびそれらの相対濃度に伴って変化するため、予測が 難しい。

最近の CRC 技術の進歩により、特定サンプルマトリッ クスにおいて、困難あるいは不可能と考えられていた濃 度レベルの分析が劇的に改善された。CRC ICP-MS では、 通常、セルは干渉イオンと反応する反応ガスを導入する (リアクションモードと言われる)。ガスおよび干渉によ り、いくつかの異なるプロセスのひとつで干渉が除去さ れる。しかしながら実際の"リアクションモードのみ" の CRC システムの限界は、反応性の高いガスおよび固 有の測定条件を使用して、1 つの分析元素について 1 つ の干渉イオンを除去することである。H₂ などのシンプル なあるいは反応性の低いセルガスを使用する装置もある が、除去が難しいマトリックスに起因する干渉イオンと の反応が遅いか、全く反応しないため、その使用は主に プラズマに起因する干渉イオンに限定される。

ヘリウム(He)コリジョンモード

Agilent オクタポールリアクションシステム (ORS) の 開発では、CRC の新しくさらに強力なヘリウムモード (ヘリウムコリジョンモード)を採用した。このモードは 反応ガスとの相対的な反応性で多原子イオンを除去する のではく、不活性ガスを衝突ガスとして使用し、すべて の多原子イオンをその大きさの違いで除去する。すべて の多原子イオンは同じ質量の分析対象元素イオンより衝 突断面積が大きいため、セルガス (衝突ガス) とより多 く衝突し (コリジョン)、セル内でより多くのエネルギー



Agilent Technologies

を失う。セル出口に到達すると、衝突断面積の大きな多 原子イオンは、分析対象元素イオンに比べて非常に低い イオンエネルギー(He ガスとの衝突により)となる。そ のため出口の電圧を調整して多原子イオンがセルから通 り抜けず、エネルギーの高い分析対象元素イオンだけが 検出器へ達するようにする。この分離プロセスは運動エ ネルギーディスクリミネーション(Kinetic Energy Discrimination, KED)として知られ、このシンプルで極 めて効果的な方法により、リアクションモードでの多く の分析上重要な利点がある。

ヘリウムコリジョンモード (ヘリウムモード)の利点:

- リアクションガスとは反対に、He は不活性でサンプ ルマトリックスと反応しないため、セル内で新たな干 渉イオンを形成しない
- He は不活性なため、分析対象元素のイオンまたは内 部標準元素のイオンと信号をロスするような反応を起 こさない
- すべての干渉(プラズマ起因およびマトリックス起因)
 を除去、減衰させるため、多元素同時スクリーニング または半定量分析が可能である
- ヘリウムモードは干渉に固有ではないため、複数の干 渉イオンを同時に、分析対象元素イオン(または異な る分析対象イオン)から除去できる[9、10]
- 反応ガスを用いた場合に必要な、分析対象元素および マトリックスに依存するメソッド作成とは対照的に、 干渉除去のいずれのリアクションモードに対しても、 サンプルマトリックスの事前の情報が不要であり、メ ソッド開発も必要ではない
- すべてのサンプル、すべてのマトリックスにヘリウム モード(コリジョン)が適応でき、すべてのアプリケ ーションに同じ設定(ガス流量)を適用できる
- セル電圧の最適化が不要
- 干渉補正式が不要

なぜ、その他の CRC-ICP-MS はヘリウムモード(コリジョン)が使用できないのか?

ヘリウムモードを正しく機能させるには、KED による分 析対象元素と干渉イオンの効率的な分離が必要で、次の 2 つの条件が必要である:まず、セルに入いる全てのイオ ンのエネルギー分布を狭く制御する必要がある。Agilent の ShieldTorch インタフェースにより、1 eV という非 常に狭いエネルギー分布が保証される:機構的に接地され たシールドプレートは、プラズマを接地した電気的に等 価なデザイン(平衡、センタータップ、または二重のコ イルなど)と比較して、初期イオンエネルギーを正しく 制御できる。次に、セル出口において分析対象元素と多 原子イオンを区別するために、セル内で十分に衝突させ る必要がある。Agilent の ORS では、オクタポールイ オンガイドを使用してこのことが達成され、ICP-MS で はオクタポールセルによってのみ可能である。オクタポ ールセルには、次の2 つの重要な利点がある:

- オクタポールの内径が小さい。結果として、セル入口 および出口開口径は小さく、そのためセルはクアドロ ポール(四重極)またはヘキサポール(六重極)セル と比較して相対的に高い圧力で動作でき、イオン/ガ スの衝突頻度が増す。
- オクタポールは、ヘキサポールおよびクアドロポール イオンガイドより良い集束効率も持つ。イオンビーム は密接に集束され、これにより高い操作圧力での良い イオン透過効率および高い感度が得られる。

ShieldTorch インタフェースとオクタポールセルの組み 合わせは Agilent ORS のみなので、Agilent ORS だけ がヘリウムモード (コリジョン)を効果的に使用できる。

ヘリウムモード (コリジョン)のテスト-最悪事態の想定

合成サンプルマトリックスを調製し、一般的な分析対象 元素の質量範囲の全域での複数の重なり合った多原子イ オン干渉により、ヘリウムモード(コリジョン)による 除去性能を評価した。複雑な天然サンプルマトリックス を模擬実験するために、1% HNO₃、1% HCl と 1% H₂SO₄(すべての UpA UltraPure 試液、英国ケンブリ ッジの Romil 社製)、1% ブタン-1-オール(SpS Super Purity、英国ケンブリッジの Romil 社製)、および Na と Ca をそれぞれ 100 mg/L (ppm) (両方とも Spex CertiPrep Assurance 単元素標準 10,000 mg/L から調 製)を含む標準溶液を調製した。表1に、このサンプル マトリックス試料の測定時に検出される可能性のある多 原子イオンを要約した。実際には 50 ~ 80 amu のすべ ての元素が複数の干渉の影響を受けることがわかる。複 雑なサンプルマトリクスにより複数の干渉が影響する状 況では干渉補正式等による数学的補正の信頼性は低く、 従来型の ICP-MS にとって、これらの元素を正確に定量 することは極めて困難である。なぜ複雑なサンプルの多 元素分析に対してリアクションセルが不適切なのか、そ の理由は1つの反応ガスですべての多原子イオンの範囲 に対して有効なガスが無い、また、それぞれいずれの反 応ガスも異なる反応性を持っているためである。しかし ながら、表1に示したすべての干渉は多原子イオンで、 そのため1つのヘリウムモード(コリジョン)を使用し て効果的に減衰できる。複数の干渉を除去するヘリウム

モード(コリジョン)の能力を検討するために、2組の スペクトルを測定した。1組はガスなしモード、もう1 組はセルにヘリウムを導入して測定した。干渉補正のよ うなデータ補正またはバックグラウンド減算は適用して いない。最後に、マトリックスサンプルに5ppbの標準 液をスパイクして測定し、すべての分析対象元素の回収 率と、同位体比を確認した。

表 1.	N、	S.	CI.	C,	Na、	および	Ca	を含む水性マトリッ	クスでの
	主な多原子干渉イオン								

同位体	主な干渉イオン
⁵¹ V	³⁵ Cl ¹⁶ O、 ³⁷ Cl ¹⁴ N
⁵² Cr	³⁶ Ar ¹⁶ O、 ⁴⁰ Ar ¹² C、 ³⁵ Cl ¹⁶ OH、 ³⁷ Cl ¹⁴ NH
⁵³ Cr	${}^{36}\text{Ar}{}^{16}\text{OH}, \ {}^{40}\text{Ar}{}^{13}\text{C}, \ {}^{37}\text{Cl}{}^{16}\text{O}, \ {}^{35}\text{Cl}{}^{18}\text{O}, \ {}^{40}\text{Ar}{}^{12}\text{CH}$
⁵⁴ Fe	⁴⁰ Ar ¹⁴ N、 ⁴⁰ Ca ¹⁴ N
⁵⁵ Mn	³⁷ Cl ¹⁸ O、 ²³ Na ³² S
⁵⁶ Fe	⁴⁰ Ar ¹⁶ O、 ⁴⁰ Ca ¹⁶ O
⁵⁷ Fe	⁴⁰ Ar ¹⁶ OH、 ⁴⁰ Ca ¹⁶ OH
⁵⁸ Ni	⁴⁰ Ar ¹⁸ O、 ⁴⁰ Ca ¹⁸ O、 ²³ Na ³⁵ CI
⁵⁹ Co	⁴⁰ Ar ¹⁸ OH、 ⁴³ Ca ¹⁶ O
⁶⁰ Ni	⁴⁴ Ca ¹⁶ O、 ²³ Na ³⁷ Cl
⁶¹ Ni	⁴⁴ Ca ¹⁶ OH、 ³⁸ Ar ²³ Na、 ²³ Na ³⁷ CIH
⁶³ Cu	$^{40}Ar^{23}Na$ 、 $^{12}C^{16}O^{35}CI$ 、 $^{12}C^{14}N^{37}CI$
⁶⁴ Zn	$^{32}S^{16}O_2, \ ^{32}S_2, \ ^{36}Ar^{12}C^{16}O, \ ^{38}Ar^{12}C^{14}N, \ ^{48}Ca^{16}O$
⁶⁵ Cu	$^{32}S^{16}O_{2}H,\ ^{32}S_{2}H,\ ^{14}N^{16}O^{35}CI,\ ^{48}Ca^{16}OH$
⁶⁶ Zn	${}^{34}S^{16}O_2$, ${}^{32}S^{34}S$, ${}^{33}S_2$, ${}^{48}Ca^{18}O$
⁶⁷ Zn	$^{32}S^{34}SH, \ ^{33}S_{2}H, \ ^{48}Ca^{18}OH, \ ^{14}N^{16}O^{37}CI, \ ^{16}O_{2}{}^{35}CI$
⁶⁸ Zn	³² S ¹⁸ O ₂ , ³⁴ S ₂
⁶⁹ Ga	${}^{32}S^{18}O_2H, {}^{34}S_2H, {}^{16}O_2{}^{37}CI$
⁷⁰ Zn	³⁴ S ¹⁸ O ₂ , ³⁵ Cl ₂
⁷¹ Ga	³⁴ S ¹⁸ O ₂ H
⁷² Ge	$^{40}Ar^{32}S$, $^{35}Cl^{37}Cl$, $^{40}Ar^{16}O_2$
⁷³ Ge	⁴⁰ Ar ³³ S、 ³⁵ Cl ³⁷ ClH、 ⁴⁰ Ar ¹⁶ O ₂ H
⁷⁴ Ge	⁴⁰ Ar ³⁴ S、 ³⁷ Cl ₂
⁷⁵ As	⁴⁰ Ar ³⁴ SH、 ⁴⁰ Ar ³⁵ CI、 ⁴⁰ Ca ³⁵ CI
⁷⁷ Se	⁴⁰ Ar ³⁷ Cl、 ⁴⁰ Ca ³⁷ Cl
⁷⁸ Se	⁴⁰ Ar ³⁸ Ar
⁸⁰ Se	⁴⁰ Ar ₂ 、 ⁴⁰ Ca ₂ 、 ⁴⁰ Ar ⁴⁰ Ca

装置

Agilent 7500 ce ICP-MS を用い、様々な高マトリクス サンプルを測定するのに典型的なチューニング条件を採 用した。(プラズマ条件は通常と同様に CeO/Ce が 0.8 %以下となるようにした。)個々の干渉ごとに、それ を低減するためのパラメータの最適化は行わなかった。 コリジョンモードの測定では、5.5 mL/min の He ガス だけをセルに導入した。

スペクトルの比較

 ガスなしモードで採取したバックグラウンドスペクトル を図 la に、ヘリウムモード (コリジョン) での同じス ペクトル(同じ質量範囲および信号強度目盛)を図 1b に示す。図 1aから、アルゴンプラズマガスおよび水性 サンプル溶液の通常のバックグラウンド成分(Ar、O、 H)と共に、合成サンプルマトリックス(HNO₃、HCl、 H₂SO₄、ブタノール、Ca および Na)の添加成分が、ガ スなしモードのスペクトルでいくつかの高い強度のバッ クグラウンドピークの形成につながることが明らかであ る。例えばプラズマからの ${}^{40}Ar^{16}O^{+}$ と ${}^{40}Ar_{2}^{+}$ だけでなく、 マトリックスからの ⁴⁰Ar12C⁺、³²S₂⁺、³⁵Cl¹⁶O⁺ などが認 められる。これら高強度のバックグラウンドピークが、 いくつかの干渉の重なる元素(炭素マトリックスでの ⁵⁶Fe、⁷⁸Se と ⁸⁰Se、⁵²Cr、硫黄マトリックスでの ⁶⁴Zn) が、これまで ICP-MS にとって難しい元素と考えられて きた理由である。

セルにヘリウムを導入すると (ヘリウムモード(コリジョ ン))、これらの高強度のバックグラウンドピークのすべ てがスペクトルから消え(図 1b に示す。図 1a と同じサ ンプル、同じレンジ表示)、ヘリウムモード(コリジョン) の効果および適用性を示している。図 2a と 2b は、さら に強度が低いマトリックス由来の多原子イオンを見るた め、図1の2つのスペクトルのレンジを100倍に拡大 して表示した。これらの干渉はプラズマに基づく多原子 イオンより強度は低いが、日常のサンプル分析で無視で きない誤差を生じる可能性がある。これらの干渉の有無 および強度はマトリックスの組成に影響され、一般の分 析ではマトリックスは試料により異なり、濃度も未知な ためである。拡大された表示では、ヘリウムモード(コ リジョン)の使用により、バックグラウンドピークが大 幅に低減したことが明らかで、これにはプラズマに起因 する高強度のバックグラウンドの ArO* と Ar₂* も含まれ ている。ヘリウムモード (コリジョン)のこのレンジで (図 2b) で明確に確認できるピークは Fe と Zn だけで ある(同位体比テンプレートにより、m/2 64、66 およ

び 68 の Zn 同位体比パターンが確認した)。これは、マ トリクスサンプル中の微量の汚染と考えている。ガスな しモードでは(図 2a)、この質量範囲のすべての元素の ほぼすべての同位体が少なくとも1つのマトリックス起 因の多原子イオンの干渉と重なり合っている。



図 1. (a)ガスなしモード、および(b)ヘリウムコリジョンモードでの複雑なマトリックスサンプルでの高強度の干渉多原子イオン (組成はテキストを参照してください)同じレンジ(2.07E7)上にて表示



図 2. (a)ガスなしモード、および(b)ヘリウムモード(衝突)での複雑なマトリックスサンプルからの低強度の干渉多原子イオン、 図 1 を 100 倍に拡大したレンジ(2.07E5)にて表示

サンプルマトリックスの存在下での分析対象元素の測定

単一のヘリウムモード(コリジョン)条件(図 1b およ び 2b)によりプラズマとマトリックスに基づく多原子イ オン両方を効果的に削減できることを証明するために、 第 2 のサンプルを分析した。今回は同じ成分のマトリッ クスに 5 ppbの混合標準液をスパイクした溶液をサンプ ルとした。干渉イオンの除去と同じセル条件において、 この質量範囲で明らかに干渉を受ける微量元素を分析す るのに十分な感度が得られることの確認を目的に、ヘリ ウムモード(コリジョン)で測定を行った。V、Cr、Mn、 Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ge、As、および Se を各 5 ppb となるように添加した。すべての元素は、ガスなし モードで少なくとも 1 つの多原子イオンが重なる分析上 有用な同位体がある。

ブランク(スパイクされていない)マトリックス試料と スパイクしたマトリックス試料をヘリウムモード(コリ

ジョン) で測定したスペクトルを、図 3a と 3b に示した。 汚染元素 (Fe, Ni, Cu, Zn) の存在を、それぞれの同位 体比テンプレート(図 3b)から確認できるように、これ らのスペクトルは、図 2a と 2b で使用された物より 4 倍小さなレンジで示した。図 3a に示されたスペクトル から、ヘリウムモード(コリジョン)により、この複雑 で困難なサンプルマトリクス中で ppb レベルの多元素同 時分析が可能なことがわかる。各分析対象元素において、 天然同位体比と一致することが示された。除去できなか った干渉イオンは、質量数がそれぞれ 57 および 80 のプ ラズマに起因する ArOH と Ar₂ だけだった。 質量数 80 の Ar_2 の信号は、 $\sim 5 \mu g/L$ の Se に同等である。しか しながら、Seのその他の同位体である m/277、78、お よび82の多原子イオン干渉は完全に除去され、これら どの同位体でも Se 測定が可能になる(⁷⁶Se も利用可能 だが、スパイク混合溶液中の 76Ge と重なる)。



図 3. ヘリウムコリジョンモードによる複雑なマトリックスサンプル、(a)V、Cr、Fe、Mn、Ni、Co、Cu、Zn、Ge、As、および Se 5 ppb を スパイク、(b)スパイクなし。信号レンジは 5.0E4(挿入図は 5.0E3)。

結論

この1つの条件化ですべての多原子イオン干渉を除去す る能力は、ヘリウムモード(コリジョン)が実用的に万 能であることを意味する。サンプルによらず、どの元素 のどの同位体に対しても適用できる。ヘリウムモード (コリジョン)は、類のない新しい操作モードを提供し、 そのモードでは各分析対象元素のすべての同位体がアク セス可能になる。言い換えると、干渉のために以前は使 用できなかった主要な同位体が(たとえば、炭素マトリ ックスでの⁵²Cr、水系サンプルでの⁵⁶Fe、ナトリウムマ トリックスでの⁶³Cu、および硫黄マトリックスでの ⁶⁴Zn)、測定可能になることを意味する。必要ならば、多 くの元素において、最も好ましい同位体と、"qualifier" として2番目に好ましい同位体の両方で測定することで 結果を検証できるため、これは分析者にとって大きな利 点である。ヘリウムモード(コリジョン)を使用して測 定すれば、2つの同位体は多原子イオンの干渉の影響を 受けないため、2つの独立した定量値を使用することで、 高い信頼性で分析結果の確認ができる。

この強力な分析モードの利点には、さらにサンプル調製 に関するものがある。これまでの(非 CRC) ICP-MS では、希釈溶液の選択肢は、ほぼ硝酸溶液に限定されて いた。塩素または硫黄に基づくマトリックス干渉の問題 のために、塩酸および硫酸を使用できなかった。今では、 標準的なヘリウムモード(コリジョン)で測定すること で、多原子イオン干渉が除去できるため、個々のサンプ ルに対して最適な分解/前処理方法を選ぶことができる。 7500ce のヘリウムモード (コリジョン) では、1 つの条 件ですべての多原子イオン干渉を効果的に除去でき、そ の結果、複雑な未知サンプルでの正確な多元素分析が可 能になることを示した。リアクションセルガスを使用す るのに比べ、不活性なセルガスを使用することで、反応 による分析対象元素シグナルの低下がないこと、そして 新しい干渉イオンが生成されない。

分析対象元素が反応により失われず、新しい干渉イオン が形成されないため、干渉の恐れのある元素と同条件で、 干渉のない元素(および内部標準元素)を測定できる。 そして全ての分析対象元素に対して1つのセル条件を適 用できるので、過渡シグナルの分析(クロマトグラフま たはレーザーアブレーション試料導入などで得られる) の他に、半定量スクリーニング分析も可能になる。

へリウムコリジョンモードは、多原子イオン干渉の影響 をうける全ての分析対象元素に適しており、そしてセル 条件の各分析対象元素毎への最適化が不要である。その ため、セル条件の検討をせずに、同じセル条件を新しい 分析対象元素に適用できる。さらに、ヘリウムモード (コリジョン)は特に個々の干渉除去のためにセットアッ プしないため、異なるマトリックスの試料や、完全に未 知のサンプルマトリックスに対しても同一のセル条件を 使用できる。これにより、日常の分析機関の作業を大幅 に簡素化できる。ORS により、ICPMS において、複雑 なほとんどの実サンプルマトリックス試料でも、セル条 件の検討のようなメソッドの作成なしに、信頼性のある 微量多元素分析が可能となる。

参照文献

- G. K. Koyanagi, V. I. Baranov, S. D. Tanner and D. K. Bohme, (2000), *J. Anal. Atom. Spectrom.*, 15, 1207.
- P. R. D. Mason, K. Kaspers and M. J. van Bergen, (1999), J. Anal. Atom. Spectrom., 14, 1067.
- J. M. Marchante Gayon, I. Feldmann, C. Thomas and N. Jakubowski, (2000), J. Anal. Atom. Spectrom., 16, 457.
- E. H. Larsen, J. Sloth, M. Hansen and S. Moesgaard, (2003), J. Anal. Atom. Spectrom., 18, 310.
- 5. H-T. Liu and S-J. Jiang, (2003), Anal. Bioanal. Chem., **375**, 306.

- D. R. Bandura, S. D. Tanner, V. I. Baranov, G. K. Koyanagi, V. V. Lavrov and D. K. Bohme, in *Plasma Source Mass Spectrometry:The New Millennium*, eds. G. Holland and S. D. Tanner, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2001, p. 130.
- C. C. Chery, K. DeCremer, R. Cornelis,
 F. Vanhaecke and L. Moens, (2003), J. Anal. Atom. Spectrom., 18, 1113.
- F. Vanhaecke, L. Balcaen, I. Deconinck, I. De Schrijver, C. M. Almeida and L. Moens, (2003), J. Anal. Atom. Spectrom., 18, 1060.
- N. Yamada, J. Takahashi and K. Sakata, (2002), J. Anal. Atom. Spectrom., 17, 1213.
- 10.E. McCurdy and G. Woods, (2004), J. Anal. Atom. Spectrom., **19**, 607.
- J. W. Olesik and D. R. Jones, (2006), J. Anal. Atom. Spectrom., 21, 141.

詳細

弊社の製品およびサービスの詳細情報に関しては、弊社 ウェブサイトをご覧ください (www.agilent.com/chem)。

www.agilent.com/chem

Agilent は、万一この資料に誤りが発見されたとしても、また、本資料の使用によ り付随的または間接的に損害が発生する事態が発生したとしても一切免責とさせて いただきます。

本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

© Agilent Technologies, Inc. 2006

Printed in Japan March 23, 2006 5989-4905JAJP

